

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 26 年 10 月 30 日 (2014.10.30)

【公開番号】特開 2014-82324 (P2014-82324A)

【公開日】平成 26 年 5 月 8 日 (2014.5.8)

【年通号数】公開・登録公報 2014-023

【出願番号】特願 2012-229198 (P2012-229198)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

C 2 3 C 16/44 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/205

C 2 3 C 16/44 J

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 9 月 16 日 (2014.9.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

気相成長装置の汚染量を測定する方法であって、

気相成長装置のチャンバー内を H C l ガスによるペーパーエッチングによりクリーニングするペーパーエッチング工程と、

前記ペーパーエッチング後の前記チャンバー内にて所定の枚数のウェーハを 1 枚ずつ順次非酸化性雰囲気中で熱処理する熱処理工程と、

前記熱処理工程で熱処理された各々のウェーハ表面上の金属不純物の濃度を前記気相成長装置の汚染量として測定する測定工程とを含み、

前記ペーパーエッチング工程及び前記熱処理工程を所定の回数繰り返し行い、前記熱処理工程では各回同じウェーハを用いて各回で熱処理するウェーハの順番を変えないようにし、前記ペーパーエッチング工程及び前記熱処理工程を前記所定の回数繰り返し行った後に前記測定工程を行うことを特徴とする気相成長装置の汚染量測定方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

上記課題を解決するための、本発明の気相成長装置の汚染量測定方法は、

気相成長装置のチャンバー内を H C l ガスによるペーパーエッチングによりクリーニングするペーパーエッチング工程と、

前記ペーパーエッチング後の前記チャンバー内にて所定の枚数のウェーハを 1 枚ずつ順次非酸化性雰囲気中で熱処理する熱処理工程と、

前記熱処理工程で熱処理された各々のウェーハ表面上の金属不純物の濃度を前記気相成長装置の汚染量として測定する測定工程とを含み、

前記ペーパーエッチング工程及び前記熱処理工程を所定の回数繰り返し行い、前記熱処理工程では各回同じウェーハを用いて各回で熱処理するウェーハの順番を変えないようにし、前記ペーパーエッチング工程及び前記熱処理工程を前記所定の回数繰り返し行った後

に前記測定工程を行うことを特徴とする。